



# マイクロナノ MICRONANO

2011  
01

## CONTENTS

- 年頭所感／1
- 寄稿「MEMSデバイスへの新しい期待」東大 下山 勲／2
- 財団法人 マイクロマシンセンター 事業の動き／3
- 技術研究組合BEANS研究所 事業の動き／6
- メンバー企業紹介「ローム(株)」／8

財団法人 マイクロマシンセンター  
<http://www.mmc.or.jp/>

技術研究組合BEANS研究所  
<http://www.beanspj.org/lab/>

# No.74

## 年頭所感

平成23年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。年頭にあたり、平素より財団法人マイクロマシンセンター及び技術研究組合BEANS研究所の活動にお寄せ頂いております皆様のご支援とご協力に、心より御礼申し上げます。

平成21年9月に両組織の理事長に就任以来、約1年3か月が経過しました。この間、リーマンショックやドバイショックからの経済的な回復基調が見えつつも、EUのギリシャ、アイルランドなどの財政危機や円高の影響、製造産業における中国などの新興国との競争激化など、国内産業は決して安穏としていられる状況ではありません。このような状況を打開していくためには、我が国産業の競争力の源泉である技術開発の一層の推進が不可欠と考えます。いまや産業のキーテクノロジーといわれるMEMS等のマイクロナノ分野に係る技術開発の一層の進展が求められているところです。今後とも本理事長職を通じまして、マイクロマシン・MEMS等マイクロナノ分野のより一層の発展に努めてまいり所存でございますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

平成20年に始まったBEANS（異分野融合型次世代デバイス製造技術開発）プロジェクトは、革新的次世代デバイス創出に必要な基盤的プロセス技術群を開発し、従来の応用分野に加えて環境・エネルギー、安心・安全、健康・医療など幅広い分野での応用を目指すものです。我が国の多分野にわたる産業を支える新たなデバイス創出による市場の底上げと拡大が期待されております。おかげさまで高い評価をいただきながら、中間の折り返しをすることができました。残りの2年間、全力を傾けてプロジェクトを推進し、将来の製品化に向けた成果創出のための研究活動に注力して参ります。

また、昨年はGデバイス@BEANSがスタートし、高機能センサーネット開発や低環境負荷型製造プロセス技術開発を進めておりますが、このプロジェクトを通じて最先端の8インチMEMS製造装置群を産総研つくばに導入し、マイクロマシンセンターMEMS協議会や産総研とも密接に連携しつつ、NMEMS拠点の整備に着手したところです。

マイクロマシンセンターにおきましては、上述のNMEMS拠点の構築を始めとして、引き続きMEMS分野の国際標準化推進、産業交流・活性化事業の推進など、我が国のMEMS産業発展のための環境整備に努めて参ります。

このほか、公益法人制度改革関連三法の施行に対応し、これまでの公益法人から一般財団法人への移行を指向して移行申請を内閣府に提出しております。認可が下りました暁には、一般財団法人として自らの役割と責任を改めて認識し、事業の着実な遂行を通じて、我が国産業の国際競争力強化や豊かな未来社会の創造に貢献して参る所存でございます。

最後となりましたが、両法人を代表しまして、本年が皆様方にとって実り多い一年になりますよう心からお祈り申し上げます。新年のご挨拶とさせていただきます。



財団法人マイクロマシンセンター  
 技術研究組合BEANS研究所  
 理事長 作田 久男

平成23年1月吉日